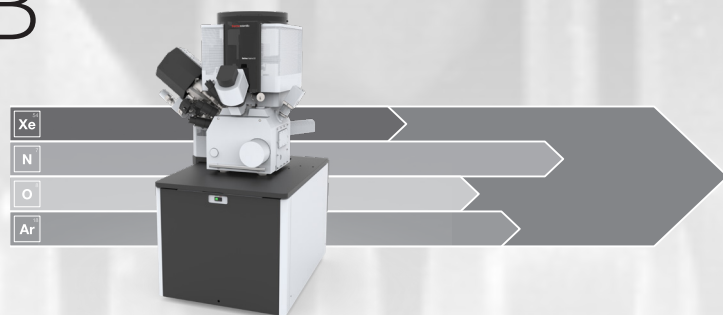


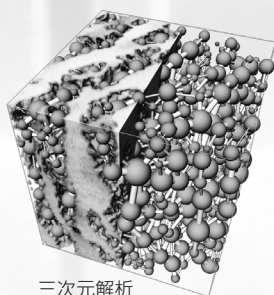
# Helios Hydra DualBeam 最新型プラズマ FIB

- 四種類のイオン源 (Ar<sup>+</sup>, Xe<sup>+</sup>, O<sup>+</sup>, N<sup>+</sup>) が利用可能
- 最大イオンビーム電流量 2.5 μA 以上
- Ga 汚染のない TEM 試料作製
- デュアルビーム(FIB-SEM)の応用範囲を拡張



## 大面積加工

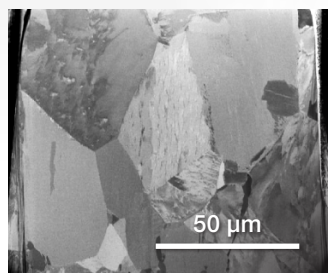
- 高速で除去し、短時間で大面積の断面加工が可能
- 視野 300 μm 以上の三次元評価
- 引張試験などの実験用試料作製に最適
- 酸素プラズマにより、炭素材料の断面を効率よくスムーズに加工
- カーテニングに最適なロッキング加工を標準装備



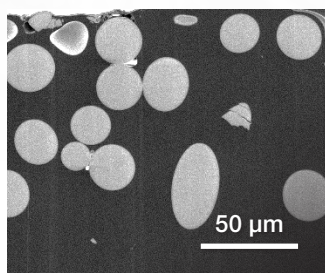
三次元解析

## 高品質 TEM 試料作製

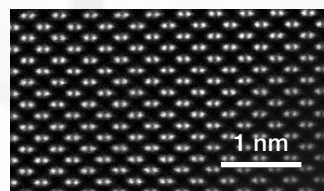
- Ar<sup>+</sup>プラズマによる薄片、および低加速ダメージ処理
- Xe<sup>+</sup>/ Ar<sup>+</sup>を利用するため、Ga<sup>+</sup>との反応や汚染を回避
- 自動リフトアウトも可能にした最新のソフトウェア AutoTEM5
- TEM 観察領域の拡大化



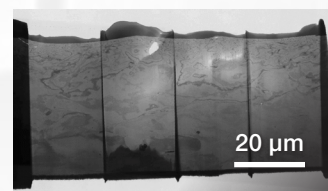
カーテニングのない断面加工



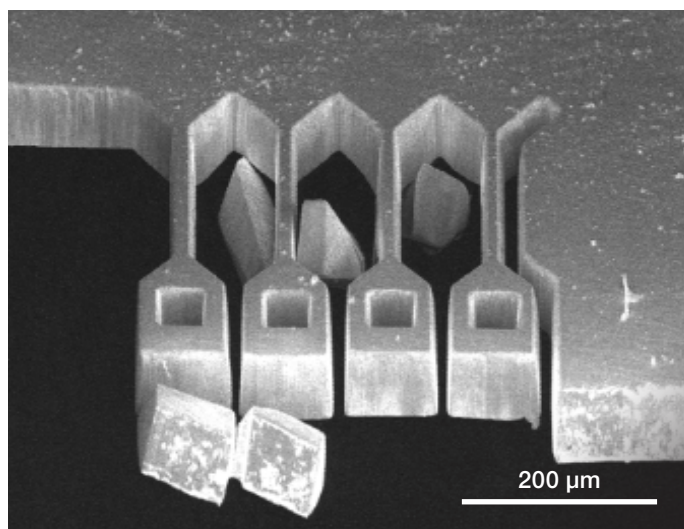
酸素プラズマによる GFRP の高品質断面加工



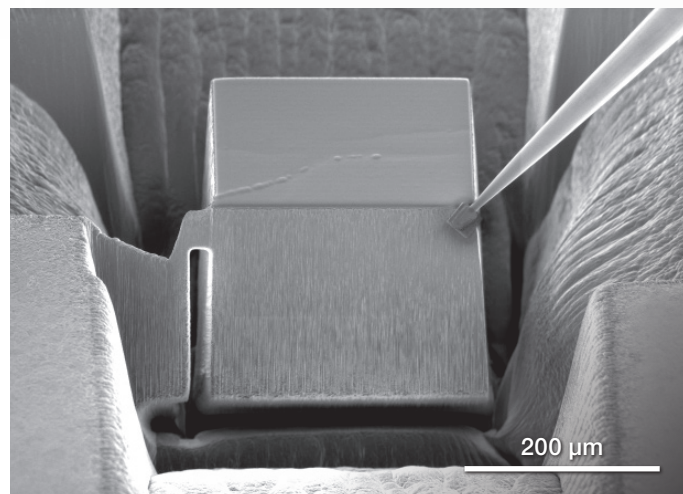
Ar<sup>+</sup>仕上げの GaAs の STEM 像



大面積の TEM 試料作製 (アルミ合金)



引張試験用試料加工



EBSD 用大容量試料の抽出

詳しくはウェブサイトにて [thermofisher.com/HeliosHydra](http://thermofisher.com/HeliosHydra)

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC